

News Release

公司联系方式: Uma Subramaniam
Sr. Marcom Manager,
Corporate Communications
(408) 875-5473
uma.subramaniam@kla-tencor.com

代理公司联系方式: David Moreno
Account Manager, MCA
(650) 968-8900 x125
dmoreno@mcapr.com

立即发布

KLA-TENCOR 为新一代电子束晶片检验系统增加在线缺陷分类功能

新功能可加速先进工艺的开发，使总拥有成本降低 50%

美国加利福尼亚州圣何塞，2002年2月19日讯—KLA-Tencor 公司 (NASDAQ: KLAC) 日前宣布，在其最新一代的电子束晶片检验系统 eS20XP 上增加在线自动缺陷分类 (iADC) 功能。与人工检验和分类的方法相比，新功能使缺陷的分类和检验速度提高三倍以上。同时，就给定检验而言，缺陷分类的能力提高了十几倍。iADC 可以使芯片制造商在检验过程中快速区分物理和电气缺陷，从而使 e-beam 检验系统的拥有成本 (CoO) 降低 50%。这一功能显著提高了芯片制造商的检验灵敏度，使他们可以集中精力查明严重影响产品产出率的缺陷，提高先进工艺的产出率。

“在产能实现的过程中，工艺改进是尤为重要且耗时的工作，” 摩托罗拉半导体产品事业部负责产出率管理的经理 David Kolar 指出。“电压差异缺陷与产出有着密切关系，因此它对先进工艺的开发具有非常重要的意义，它可确保工厂精确可靠地检验并区分每一种缺陷，以便从众多的缺陷中识别出对产出率构成致命影响的缺陷。KLA-Tencor 公司 eS20XP 系统的 iADC 功能可以大大缩短完成这项重要工作所需的时间。iADC 目前的性能已经十分精确而且具有很好的一致性，完全可以用于关键的后端检验。”

缩短产能实现过程是帮助芯片制造商识别、分析和解决工艺问题的关键，这些问题的存在将对产出和经济效益造成影响。电子束晶片检验对加快产能调整尤为关键，因为它使芯片制造商可以在每一个生产步骤中都去检查存在的电气故障，而无需等到最终阶段。这种敏感性对先进工艺的实现也十分重要，因为先进工艺需要芯片制造商能够掌握全部类型的缺陷，然后从中分离出对产出造成严重影响的缺陷。

具备 iADC 功能的 eS20XP 检验系统，可以使用户在检验过程中实时区分物理和电气缺陷，并进行分类，同时对生产过程没有丝毫影响。iADC 的另一优点是，它能够在 eS20XP 或离线检验扫

-接下页-

KLA-TENCOR 为 E-BEAM 晶片检验系统集成在线 ADC 功能……………2/2 页

描电子显微镜上，为人工检验生成更加智能、或者更加典型的缺陷样本。这样一来，eS20XP就可以解放出来，用于检验更多的晶片，从而降低工具的拥有成本，并缩短采取修改措施的时间。对于要求极为严格的检验，iADC 还可以充当严重缺陷的高效过滤器。

“iADC的智能分类技术使eS20XP成为在线晶片监控、工艺开发、以及大规模生产所必不可少的工具，” KLA-Tencor 晶片检验事业部执行副总裁 Rick Wallace评价说。“iADC具有可靠而精确地进行更多敏感检验的能力，这可以显著改善eS20XP的性能，使其成为帮助客户加速产能实现的强劲工具。”

iADC 选件可在现场升级，也可配置在厂家发运的新 eS20XP 系统中。目前，iADC已在七个客户的场地安装。

KLA-Tencor 公司简介：KLA-Tencor 是全球领先的专为半导体制造和相关行业提供过程控制和产出管理解决方案供应商。公司总部设在美国加利福尼亚州圣何塞，在世界各地设有办事处和服务机构。作为 S&P500 强企业，KLA-Tencor 公司在 Nasdaq 上市交易，交易代码 KLAC。欲了解更多信息，请访问公司网站<http://www.kla-tencor.com>

###